



FIZIKA – MATEMATIKA FAKULTETI



F.I.SH.: Qurbanov Muzaffar Qadamboyevich

LAVOZIM: Dotsent

ТЕЛ: +99897 512 95 49

E – mail: <u>muzaffarqq@mail.ru</u>

TASHKILOT TEL: +99862 2246700

TASHKILOT MANZILI: Urganch shahar Xamid Olimjon koʻchasi 14. 220100

DARAJASI	oliy, 1999 yil, UrDU, fizika-matematika fakulteti
TAJRIBA	1999 – 2001 – UrDU fizika kafedrasi laboranti; 2001 – 2002 – Fizika kafedrasida UrDU tinglovchisi; 2002 – 2005 – UrDU fizika kafedrasi aspiranti; 2005 – 2013 – UrDU Fizika kafedrasi oʻqituvchisi; 2013 yildan hozirgi kungacha – UrDU fizika kafedrasi dotsenti.
MUTAXASISLIGI	Physical electronics.
O'QITADIGAN FANLARI	Elektromagnetizm, radioelektronika.
TADQIQOT ISHI	Распыление кристалла LiF при облучении моно–и полиатомными ионами Ar^+ и SF_5^+
TADQIQOTLARI	1. Распыление кристалла LiF при облучении моно—и полиатомными ионами Ar^+ и SF_5^+ 2. Травление поверхности карбида кремния при бомбардировке молекулярными ионами SF_n^+ (n=1÷5) 3. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла LiF(100) при бомбардировке полиатомными ионами SF_n^+ 4. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла SiC при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными SF_5^+ ионами 5. Физическое и химически-стимулированное распыление 3C-SiC при бомбардировке ионами Ar^+ и полиатомными ионами SF_5^+ 6. Распыление кристалла LiF при облучении моно-и полиатомными ионами Ar^+ и SF_5^+ 7. Эмиссия атомарных и молекулярных ионов из LiF от энергии и скорости бомбардирующих ионов Ar^+ и SF_5^+ 8. Распыление монокристалла LiF при бомбардировке полиатомными ионами SF_n^+ (n=1÷5) 9. Эмиссия атомарных и молекулярных ионов из кристалла LiF при облучении моно Ar^+ и полиатомными SF_n^+ (n=1÷5) 10. Сверхвысоковакуумный вторично-ионный масс-спектрометр для изучения травления и структуры поверхности полупроводников и диэлектриков при облучении электронами, моно и полиатомными ионами 11. Распыление кремния и карбида кремния при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными ионами SF_5^+ 12. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла LiF(100) при бомбардировке полиатомными ионами SF_n^+ (n=1÷5)

- 13. Распыление кремния и карбида кремния при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными ионами SF_5^+
- 14. Распыление поверхности карбида кремния при бомбардировке молекулярными ионами ${\rm SF_5}^+$
- 15. Распыление поверхности кремния и карбида кремния при бомбардировке молекулярными ионами $SF_n^+(n=1\div 5)$
- 16. Физическое и химическое распыление карбида кремния при бомбардировке моно ${\rm Ar}^{\scriptscriptstyle +}$ и полиатомными ионами ${\rm SF_5^{\scriptscriptstyle +}}$
- 17. Анализ фторированной поверхности карбида кремния методом электронностимулированной десорбции
- 18. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла SiC при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными SF_5^+ ионами
- 19. Исследование распыления и топографии поверхности монокристалла LiF(100) при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными ионами SF_5^+
- 20. Исследование стимулированного разрывом связей молекулярного распыления и травления поверхности пленки 3C-SiC при бомбардировке моно Ar^+ и полиатомными SF_5^+ ионами
- 21. Кинетика точечных дефектов и их агрегатов на поверхности пленки LiF/Si(111)
- 22. Изучение отрицательно-ионных кластеров SiC при бомбардировке ионами Cs⁺
- 1. Распыления кристаллов при бомбардировке моно- и полиатомными ионам
- 2. Kinetics of aggregations F2, F3, X and colloid centers in thin film LiF/Si(111) at low temperature annealing
- 3. Исследование рассеяния ионов со ступенчатой поверхности двухкомпонентных монокристаллов
- 4. Температурный эффект атомарного и кластерного распыления SiC(100), GaN и LiF(100) при облучении ионами Cs^+ и SF_5^+
- 5. Регистрация дефектов в спектрах ВИМС при отрицательно-ионном распылении кристаллов LiF
- 6. Молекулярное распыление из кристалла LiF при бомбардировке полиатомными ионами $SF_n^+(n=1-5)$
- 7. Изучение массового состава положительно распыленных частиц из кристалла LiF при облучении ионами ${\rm Ar^{\scriptscriptstyle +}}$
- 8. Отрицательно-ионное распыление Al₂O₃
- 9. Распыления тонких плёнок, покрытой на поверхность Au(111) при бомбардировке ионами Ar^+
- 10. Распыления тонких плёнок, покрытой на поверхность $\mathrm{Au}(111)$ при бомбардировке ионами Ar^+
- 11. Mechanism of Aggregation Colloid Centers on Surface Ionic Crystals
- 12. Procedure for Determining Defects in Sputtered Clusters of Ionic Crystals
- 13. Изучения закономерности рассеяния ионов Ar^+ и Ne^+ с поверхности кластера кремния
- 14. Температурные зависимости распыления поверхности Si (111) при облучении ионами Cs
- 15. Влияние низкоэнергетических электронов на поверхность кристаллов оксида пинка
- 16. Электронно-спектрометрический контроль процесса очистки кремниевых пластин
- 17. Angular and energy distributions of low-energy argon ions at the scattering from $A^{\rm III}B^{\rm V}$ semiconductor surface
- 18. Исследование малоугловое рассеяния ионов с поверхностью InP(001)
- 19. Изучение характерных траектории рассеяных ионов с поверхностью InP(001) при бомбардировке ионами Ar^+ и Ne^+
- 20. Закономерности рассеяния ионов с поверхностью InP(001) при малых углах скольжениях
- 21. Рассеяния ионов с дефектной поверхностью InP(001) при малых углах скольжениях
- 22. LiF кристалини якка ва кўпатомли ионлар таъсирида чанглатиш

HOZIRGI TADQIQOTLARI